

デバイス稼動(通電)状態での極微量放出ガス分析ができる・・・

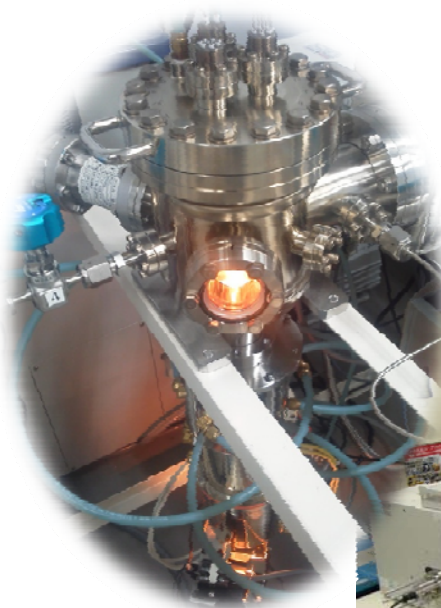
昇温脱離ガス分析装置(ダイナミック型) 応用セミナー

日時 2016年3月16日(水) 13:30~16:30 (受付開始: 13:00~)

場所 キャンパス・イノベーションセンター東京 5階501 (東京都港区芝浦3-3-6)

13:30~14:50 「昇温脱離ガス分析装置(ダイナミック型)の原理」
樋口 哲夫 氏(工学博士 日本電子株式会社)

内容 15:10~16:30 「昇温脱離ガス分析装置(ダイナミック型)の応用」
栗巢 普揮 氏(山口大学理工学研究科 准教授)



主催: 山口大学微細加工支援室
協賛: 日本真空工業会
ナノテクノロジープラットフォームセンター

アクセスマップ

JR山手線・京浜東北線 田町駅(芝浦口) 徒歩1分
都営三田線・浅草線 三田駅(A4出口) 徒歩5分



お申し込みについて

※当日受付もしており事前申込無しでもご参加頂けますが、資料等の準備の都合上、できるだけ3月9日までに事前申込のうえ、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

お問合せ&お申込み先: 山口大学 大学研究推進機構 微細加工支援室

TEL・FAX: (0836) 85-9993 E-mail: nanotech@yamaguchi-u.ac.jp
<http://www.nanotech.sangaku.yamaguchi-u.ac.jp/>

■参加者募集中！

「昇温脱離ガス分析装置（ダイナミック型）応用セミナー」

【日時】2016年3月16日（水）13：30～16：30 <受付13：00～>

【場所】キャンパスイノベーションセンター東京 5階501
（東京都港区芝浦3-3-6）

<http://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~tokyo/access/access.html>

【主催】山口大学 大学研究推進機構 微細加工支援室

【協賛】日本真空工業会
ナノテクノロジープラットフォームセンター

【参加費】無料

参加申込書

お申込みの際は、微細加工支援室ホームページの参加受付フォームから送信いただくか、下記の申込書に各事項をご記入のうえ、E-mail又はFAXにてご連絡くださいますようお願いいたします。ご記入いただく個人情報につきましては、今回のセミナーのみ使用し、これ以外の目的で利用することはありません。

ご所属	お名前	電話番号	E-mail

お申込みについて

※当日受付もしており事前申込無しでもご参加頂けますが、資料等の準備の都合上、できるだけ3月9日までに事前申込のうえ、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

<お問合せ＆お申込み先>

山口大学 大学研究推進機構 微細加工支援室

TEL・FAX：（0836）85-9993

E-mail：nanotech@yamaguchi-u.ac.jp

<http://www.nanotech.sangaku.yamaguchi-u.ac.jp/>